

CCD激光衍射测径系统的标定方法

何丽桥¹, 高岩², 王国光¹

1. 吉林大学 物理学院, 长春 130022; 2. 吉林大学 化学学院, 长春 130022

收稿日期 2007-4-25 修回日期 网络版发布日期 2008-3-4 接受日期

摘要 对测量细丝直径在10~40 μm的电荷耦合器件激光衍射测径系统提出了两种新的标定方法, 并对不同标定方法下的系统进行了测试对比。结果表明, 选择恰当的标定方法可以使系统测量精度达到0.15 μm。

关键词 [光电子学与激光技术](#), [电荷耦合器件](#), [激光衍射](#), [标定方法](#), [细丝](#)

分类号 [TN241](#)

Calibration method for CCD laser diffraction filament diameter measurement system

He Li-qiao¹, Gao Yan², Wang Guo-guang¹

1. College of Physics, Jilin University, Changchun 130022, China; 2. College of Chemistry, Jilin University, Changchun 130022, China

Abstract : Two new calibration methods for the charge coupled device(CCD) laser diffraction system to measure the filament diameter in the range of 10~40 μm were proposed, and the systems with different calibration methods were tested comparatively. The results show that the system accuracy can reach 0.15 μm under appropriate calibration.

Key words [optoelectronics and laser](#) [charge coupled device\(CCD\) laser diffraction](#) [calibration method](#) [filament](#)

DOI:

通讯作者 何丽桥 heliqiao@jlu.edu.cn

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(342KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含](#)

[“光电子学与激光技术,电荷耦合器件,激光衍射,标定方法,细丝” 的相关文章](#)

▶ [本文作者相关文章](#)

- [何丽桥](#)
- [高岩](#)
- [王国光](#)